

Было получено 1000 копий журнала в 1997 г. включая 100 экземпляров для научных и учебных заведений.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В ИНЖЕКЦИОННЫХ ЛАЗЕРАХ С ВНЕШНИМ РЕЗОНАТОРОМ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МАЛЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

Э.А. САДЫХОВ, Р.Г. ГАМИДОВ

ТУБИТАК, Национальный Метрологический Институт
п/я 21-41470, Гебзе, Турция

Э.К. ГУСЕЙНОВ

Институт Фотоэлектроники АН Азербайджана
370141, ГСП Баку, ул. Ф.Агаева, 555 квартал

Разработан новый метод для измерения малых перемещений на основе инжекционного лазера с внешним резонатором (ИЛВР). Благодаря обратной оптической связи, регистрируется изменение частоты ИЛВР вследствие механических колебаний исследуемого объекта. Теоретический предел разрешения данного метода ограничен квантовыми шумами лазера, в то время как в реальных экспериментах удалось достичь порога в 0,5 нм.

1. Введение

В последние годы предметом интенсивных исследований являются бесконтактные методы измерения малых перемещений [1,2]. Такой интерес несомненно связан с растущим их применением в целях диагностики и неразрушающего контроля движущихся узлов и механизмов в индустрии. Среди всех других имеющихся методов для измерения вибрационных параметров, оптические методы обладают рядом преимуществ, такими как высокая чувствительность, широкий динамический диапазон и т.д. В зависимости от физических принципов, на основе которых производятся измерения, оптические методы в свою очередь делятся на три группы: интерферометрические, методы на основе модуляции параметров лазерного излучения и методы с использованием импульсных лазеров.

Резкий прогресс в технологии изготовления полупроводниковых лазеров открыл новые перспективы в широком их применении в прикладных задачах и метрологических целях [3]. Полупроводниковые лазеры очень чувствительны к обратной оптической связи [4]. Учитывая этот факт, разработан новый метод для бесконтактного измерения малых перемещений с субнанометровым разрешением. Предлагаемый метод основан на регистрации изменения частоты инжекционного лазера с внешним резонатором вследствие механических колебаний исследуемого объекта. В данной схеме движущийся объект служит внешним зеркалом ИЛВР. Перемещение внешнего зеркала вызывает изменение длины лазерного резонатора, что служит причиной изменения частоты лазерного излучения, которое регистрируется с помощью интерферометра Фабри-Перо. Настоящий метод, в отличие от классических схем на основе интерферометра Майкельсона менее критичен к отражающей способности вибрирующей поверхности, а теоретический предел пространственного разрешения метода определяется квантовыми шумами лазера и изменением оптической длины резонатора вследствие тепловых флуктуаций.

2. Экспериментальная установка для измерения малых перемещений.

Блок-схема экспериментальной установки для измерения малых перемещений активным лазерным методом показана на рис.1. Часть излучения инжекционного лазера ИЛ с помощью микрообъектива МО, полупрозрачного зеркала ППЗ, зеркала З на пьезокерамике ПЗТ и линзы Л фокусируется на поверхность движущегося объекта ДО. В проводимых экспериментах использовался одномодовый полупроводниковый лазер AlGaAs типа SDL-5401-G с длиной волны 780 нм. Оптический луч, отраженный от поверхности ДО и попадающий в лазер, создает нерезонансную обратную оптическую связь. Таким образом, ДО выполняет функцию внешнего зеркала инжекционного лазера с внешним резонатором. Оптический изолят ОИ, используемый в экспериментальной установке, предназначен для устранения влияния многократно отраженных лучей от поверхностей оптических элементов на обратную оптическую связь.

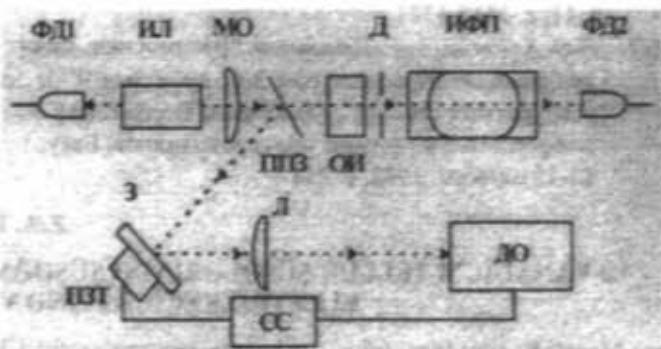


Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки для измерения малых перемещений.

Как известно, частота ИЛВР определяется длиной внешнего резонатора L , иными словами расстоянием от ИЛ до поверхности ДО. Изменение длины резонатора

ИЛВР на величину ΔL наводит сдвиг частоты лазерного излучения Δv . Частотный спектр лазера регистрируется с помощью конфокального интерферометра Фабри-Перо (ИФП) и фотодиода ФД2. Расстояние между максимумами пропускания ИФП, используемого в экспериментальной схеме составляла 600 МГц, а ширина резонанса 30. Используя частотную шкалу, определяемую характеристиками ИФП, определяется сдвиг частоты лазера Δv . Для более точного определения частотного сдвига Δv использовалась модуляционная техника. В этом случае ток лазера I модулировался синусоидальным сигналом на частоте F , которая обычно в проводимых экспериментах составляла 10-300 МГц.

$$I = I_0 + I_1 \sin(2\pi F t) \quad (1)$$

Модуляция тока лазера вызывает расщепление резонансов в спектре пропускания ИФП на основной и два боковых, отстоящих от основного на величину $2F$ (Рис.2). Для частотного спектра, показанного на рис.2 частота модуляции составляет 95 МГц.

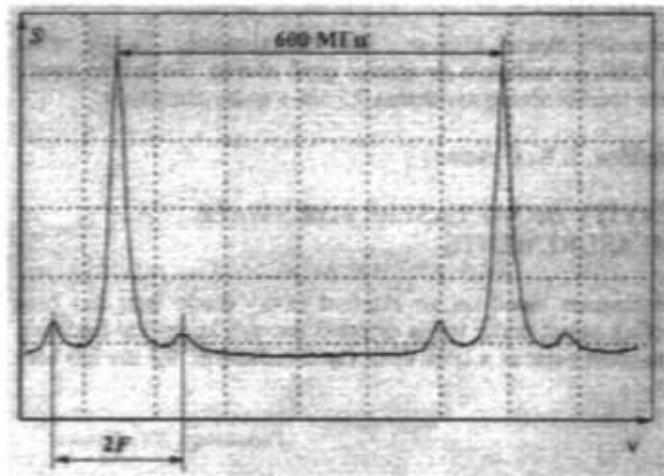


Рис. 2. Спектр пропускания интерферометра Фабри-Перо в случае модулированного тока лазера.

Принимая во внимание тривиальную связь между частотным сдвигом Δv и изменением длины резонатора ΔL ,

$$\frac{\Delta v}{v} = \frac{\Delta L}{L}, \quad (2)$$

где L - длина резонатора ИЛВР, а v - оптическая частота лазера, измерение Δv позволяет определить величину ΔL . Как видно из (2), для вычисления абсолютной величины перемещения вибрирующей поверхности необходимо с высокой точностью определить значение коэффициента $K = L/v$. Во избежание дополнительных трудностей в определении расстояния L между зеркалами лазерного диода и поверхностью движущегося объекта, значение коэффициента K вычислялось исходя из параметров калиброванной пьезокерамики ПЗТ (Dr. Lutz Pickermann GmbH, Тип: HPSt: 500/15-8/5). Калибрация пьезокерамики производилась по классической схеме интерферометра Майкельсона с использованием полупроводникового лазера с внеш-

ним резонатором, стабилизированного по линии D_2 атомов Cs (длина волны λ составляет 852.112 нм). Напряжение, необходимое для калибрации ПЗТ, а также для приведения в движение электродинамического генератора вибраций, на поверхности которого монтировался движущийся объект, прикладывалось с серво-системы СС.

Отличительной особенностью экспериментальной установки является тот факт, что в зависимости от абсолютного значения амплитуды вибраций ДО возможны две принципиально разные схемы измерения. В случае перемещений ДО в диапазоне 0.4-10 мкм выходная мощность полупроводникового лазера, регистрируемая ФД1, замодулирована по периодическому закону, в идеальном случае по синусу, что является следствием интерференции луча, отраженного от поверхности ДО и луча в первичном лазерном резонаторе [5]. В таком случае, определяя число интерференционных максимумов N за период вибраций, амплитуда перемещений c вычисляется как:

$$c = N \frac{\lambda}{2} \quad (3)$$

Результаты эксперимента

Измерения малых перемещений с использованием активного лазерного метода можно разделить на две группы: измерения для амплитуды вибраций более 0.4 мкм и для амплитуды вибраций меньше 0.4 мкм. Первая группа исследований достаточно хорошо описана в литературе [5,6], поэтому предметом основного интереса являлось измерение перемещений в диапазоне 1.5-400 нм.

В качестве движущегося объекта был выбран вибрационный сенсор фирмы Brüel & Kjaer типа 8305, который используется в качестве стандарта в вибрационных измерениях. Тем самым исследовалась возможность применения данного метода с целью калибрации подобных сенсоров, который заключается в независимом измерении амплитуды вибраций, как правило, перемещения c или ускорения a , и электрического заряда q , наводимого на выходе сенсора вследствие механических вибраций.

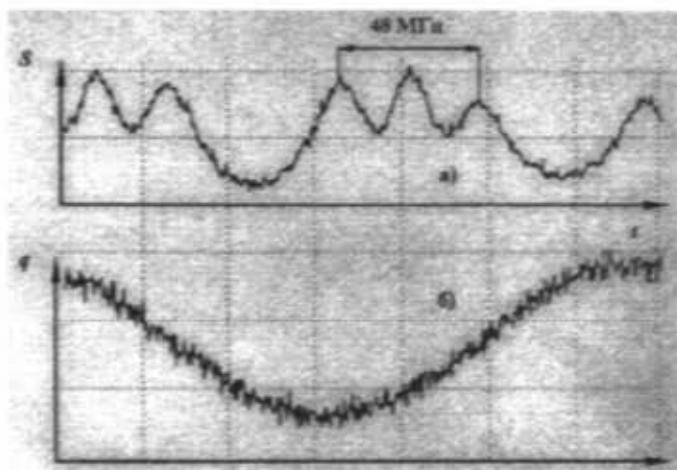


Рис. 3. График зависимости пропускания интерферометра Фабри-Перо (а) и электрического заряда наводимого на выходе вибрационного сенсора (б) от времени.

